

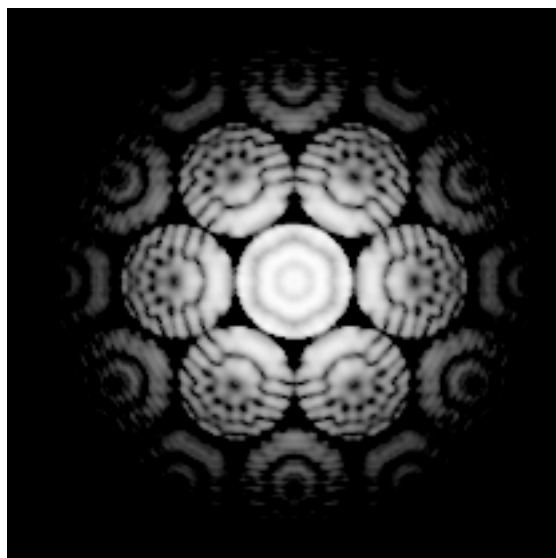
Optional
Function

CBED

for *MacHREM*TM / *WinHREM*TM

Coherent Convergent Beam Electron Diffraction
Pattern Simulation Program

収束電子線回折 シミュレーションプログラム



シリコン [111] 入射の CBED シミュレーション像

このプログラムは収束電子線回折像 (CBED 像) を計算するもので、高分解能電子顕微鏡像のシミュレーションのためのプログラムである *MacHREM*TM / *WinHREM*TM の拡張機能として追加されたものです。

- 使いやすいユーザーインターフェース
初心者でも容易にデータ作成、計算の実行を行うことができます。
- 信頼のおけるアルゴリズム
*MacHREM*TM / *WinHREM*TM で採用されているマルチスライス法にもとづく動力学的散乱計算を基本としています。
- 高品位な画像出力
Mac OS / Windows の標準画像フォーマットで高品位な濃淡像を生成し、印刷、他のアプリケーションへのコピーが可能です。

お問い合わせ先

有限会社 HREM (HREM Research Inc.)

〒355-0055 埼玉県東松山市松風台 14-48

email: support@hremresearch.com

東京事務所: 千代田区 2 番町 11-10-503



文献:

K. Ishizuka: Multislice Implementation for Inclined Illumination and Convergent-Beam Electron Diffraction, Proc. Intern'l Sympo on Hybrid Analyses for Functional Nanostructure, (1998) 69-72.

H. Inui, A. Fujii, K. Tanaka, H. Sakamoto, K. Ishizuka: New electron diffraction method to identify the chirality of enantiomorphic crystals, Acta Cryst. B59 (2003) 802-810.